

Japanese Utility Model Laid-Open No. **Sho 63-57734**

Date of Publication :April 18, 1988

Title of the Device: Semiconductor Manufacturing
Apparatus

What is claimed is:

A semiconductor manufacturing apparatus mounted in a clean room while the clean room is partitioned into a wafer transferring area and a maintenance area characterized in that a sub-operating unit is removably arranged at the maintenance area in addition to an operating unit installed at the wafer transferring area.

Brief Description of the Drawings

Fig.1 is a top plan view for showing a semiconductor manufacturing apparatus of one preferred embodiment of the present utility model.

Fig.2 is a constitution block diagram for showing a connecting constitution of a control unit of Fig.1.

1 ... wafer transferring area, 2 ... maintenance area,
3 ... partition, 4 ... main operating unit, 6 ... apparatus
main body, 7 ... sub-operating unit, 8 ... connecting
connector,

In Fig.2: 42 ... keyboard, 61 ... I/O unit, 62 ... micro-computer, 63 ... personal computer, 72 ... keyboard

⑩ 日本国特許庁 (JP) ⑪ 実用新案出願公開
 ⑫ 公開実用新案公報 (U) 昭63-57734

⑬ Int. Cl. 1

H 01 L 21/02
 G 06 F 15/46
 H 01 L 21/68

識別記号

厅内整理番号

7168-5F
 7313-5B
 A-7168-5F

⑭ 公開 昭和63年(1988)4月18日

審査請求 未請求 (全1頁)

⑮ 考案の名称 半導体製造装置

⑯ 実 願 昭61-151468

⑰ 出 願 昭61(1986)10月3日

⑱ 考案者 城尾 和博 山口県下松市大字東豊井794番地 日立テクノエンジニアリング株式会社笠戸事業所内

⑲ 考案者 井上 智巳 山口県下松市大字東豊井794番地 日立テクノエンジニアリング株式会社笠戸事業所内

⑳ 考案者 西畑 廣治 山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場内

㉑ 出願人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

㉒ 出願人 日立テクノエンジニアリング株式会社 東京都足立区中川4丁目13番17号

㉓ 代理人 弁理士 小川 勝男 外1名

㉔ 実用新案登録請求の範囲

クリーンルーム内にウエハ搬送用エリアとメンテナンスエリアとに間仕切りして設置される半導体製造装置において、前記ウエハ搬送用エリア側に設けられた操作部とは別に、前記メンテナンスエリア側に副操作部を着脱可能に設けたことを特徴とする半導体製造装置。

図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例である半導体製造装

置を示す平面図、第2図は第1図の制御部の接続構成を示す構成ブロック図である。

1 ……ウエハ搬送用エリア、2 ……メンテナンスエリア、3 ……間仕切り、4 ……主操作部、6 ……装置本体、7 ……副操作部、8 ……接続用コネクタ。

